（片平）外国人研究員等宿泊施設新営その他機械設備工事	357	165
（青葉山３）エネルギーセンター棟新営その他工事	201	121
（青葉山３）基幹整備（受変電設備）工事	144	87
（青葉山３）基幹整備（電気設備Ⅰ）工事	87	87
（青葉山３）基幹整備（機械設備Ⅰ）工事	246	123
東北大学（青葉山３）基幹・環境整備（道路・排水・共同溝等）工事	1,902	350

３．重要な物品供給契約　（単位：百万円）

件　名	契約金額	翌期以降支払金額
住友重機械工業㈱製　粒子加速装置ＡＶＦサイクロトロン修繕業務　一式	283	283
ヘリウム液化システム　一式	342	342
(仏)カメカ社製リフレクトロン型三次元アトムプローブシステム　一式	157	157
㈱東芝製30Ｔハイブリッドマグネット用大口径超伝導マグネットシステム修繕業務　一式	166	166
工藤電機㈱製　８MW電源・水冷却設備　一式	688	688
(米)ＩＭＡＧＯ社製　三次元アトムプローブ装置修繕業務　一式	120	120
(米)ＲＤＩ社製　ダイナミトロン加速器装置修繕業務　一式	217	217
住友重機械工業㈱製　ハイブリッドマグネット用無冷媒大口径超伝導マグネット　一式　外１点　修繕業務　一式	280	280
㈱トーキン製　サイクロトロンビーム輸送システム修理　一式	202	120
電子ライナック低エネルギー部（Ａ部）真空機器システム　一式	31	31
日本電子㈱製　電子ビーム描画装置　ＪＢＸ―5500ＳＤ　一式	79	79
電子ライナック低エネルギー部（Ａ部）高電圧パルスシステム　一式	62	62
サイクロトロン用電源の復旧業務　一式	91	91
古河電気工業㈱製　10Ｔ大口径超伝導マグネット用強化Nb３Sn線　一式	70	70
㈱ユーテック製　ＴＥＯＳ・オゾンＣＶＤ装置修繕業務　一式	89	89
シンクロトロン入射用電子ライナックシステム　一式	658	658
日本電子㈱製　超伝導核磁気共鳴装置　ＪＮＭ―ＥＣＡ700　一式	104	104
住友精密工業㈱製　Deep RIE装置　ＭＵＣ21ＳＲ(複合分子ポンプ特型含む)　一式	65	65
ストレッチャーブースターリング用電磁石電源　一式	409	409
(独)ブルカー・エイエックスエス社製　ＣＣＤ搭載高輝度Ｘ線構造解析システム　ＳＭＡＲＴＵＬＴＲＡ／ＴＨＫ　一式	54	54
30Ｔハイブリッドマグネット用ヘリウム液化冷凍装置　一式	257	257
電子ライナック冷却システム修繕・改修業務　一式	59	59
サムコ㈱製　薄膜形成用プラズマＣＶＤ装置　ＰＤ―220ＮＬ　一式	43	43
日本電子㈱製　極微細スピンメモリ素子用電子線描画装置　ＪＢＸ―6300ＳＫ　一式	189	189
㈱島津製作所製　10MN大型構造物性能評価システム　ＵＨ―Ｃ10MNＸ　一式	184	184
㈱湯山製作所製　注射薬自払出しシステム　一式	183	183
Yb―dopedファイバーレーザー装置　一式	42	42
超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡　一式	71	71
東京エレクトロン㈱製　ＬＰＣＶＤ装置修繕作業　一式	49	49
ストレッチャーブースターリング用パルス電源　一式	54	54
東レエンジニアリング㈱製　フリップチップボンダー　ＦＣ3000Ｗ（□22㎜耐圧ヘッド）　一台	62	62
(米)ＦＥＩ社製　Helios600iFIB／SEMデュアルビームシステム　一式	99	99
㈱日立ハイテクノロジーズ製　日立走査透過電子顕微鏡　一式	267	267
㈱リガク製　薄膜Ｘ線回折装置ＡＴＸ修繕業務　一式	31	31
(米)ＬＥＣＯ社製　微量元素精密分析装置　一式	40	40
光洋サーモシステム㈱製　ランプアニールシステムＲＬＡ―1208―Ｖ　一式	34	34